

NEW MULTI-FUNCTIONAL MICRO- AND NANOIMPRINT SOLUTION FROM EV GROUP OFFERS UNPRECEDENTED FLEXIBILITY FOR HIGH-VOLUME OPTICAL DEVICE MANUFACTURING – January 19, 2022

EV Group (EVG), a leading supplier of wafer bonding and lithography equipment for the MEMS, nanotechnology and semiconductor markets, today introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. This industry-ready, multi-functional system is designed to serve advanced R&D and production needs for a wide range of emerging applications involving micro- and nano-patterning as well as functional layer stacking.

欢迎访问EEChina! [登录 | 免费注册] 手机版 官方微博 微信公众号

得捷电子 OPA397 单路低失调、低噪声 RRIO e-trim™ 运算放大器 [了解详情](#)

贸泽电子 新品上架 **AT24CSWx串行EEPROM**

车规级电子元件的可持续供货渠道
授权代理 | 许可生产再制造 | 生产服务

MICROCHIP

www.rocelec.cn

TEXAS INSTRUMENTS

EEChina.com 首页 · 新闻 · 新品 · 文章 · 下载 · 电路 · 问答 · 视频 · 职场 · 杂谈 · 会展 · 工具 · 博客 · 论坛 · 研讨会

单片机/处理器 FPGA 软件/编程 电源 模拟电子 PCB设计 测试测量 无源/分立 音视频/显示 MEMS 系统设计 消费电子 工业/测控 汽车电子 通信/网络 医疗电子 机器人

当前位置: EEChina首页 > 消费电子 > 新闻

EV集团新型多功能微纳米压印解决方案为大批量光学设备制造赋予前所未有的灵活性

发布时间: 2022-1-20 10:46 发布者: 焦点讯

EVG®7300是EV集团最先进的解决方案,能够在单个平台中结合多种紫外线工艺,包括纳米压印光刻(NIL)、透镜成型和透镜堆叠(UV键合)

2022年1月19日,奥地利圣弗洛里安- - 微机系统(MEMS)、纳米技术和半导体市场晶圆键合与光刻设备领先供应商EV集团(EVG)现推出EVG®7300自动化SmartNIL®纳米压印与晶圆级光学系统。EVG7300是EV集团最先进的解决方案,在单个平台中结合了多种紫外线工艺技术,包括纳米压印光刻(NIL)、镜片成型和镜片堆叠(紫外线键合)。这部面向行业的多功能系统旨在满足多种新兴应用的研发和生产需求,这些新兴应用大多涉及微米和纳米图案成型以及功能层堆叠技术,包括晶圆级光学系统(WLO)、光学传感器和投影仪、汽车照明、增强现实耳机波导、生物医学设备、超透镜和超表面,以及光电子学应用。EVG7300支持最大300毫米晶圆尺寸,具有高精度调准、先进工艺控制和高吞吐量等优势,可满足多种自由曲面和高精度纳米和微光学元件与器件的大批量制造需求。



EVG®7300自动化SmartNIL®纳米压印与晶圆级光学系统在单个平台中结合了多种紫外线工艺技术,是一套先进的多功能解决方案。

OPA397单路低失调、低噪声运算放大器

新品上架: AT24CSWx串行EEPROM

长文标准逻辑器件的授权供货渠道

- #### 厂商推荐
- Microchip视频专区
 - 使用MPLAB® Harmony v3创建基于PIC32MZ
 - 如何学习和使用ATSHA204A安全认证芯片
 - 使用MPLAB® Harmony v3创建基于SAM E70
 - 基于dsPIC33的数字式降压DC/DC变换器的原
 - 贸泽电子专区
 - 轻松查询您所需的供货情况
 - 免费库存管理工具让你一键享有
 - 免费获取贸泽ECAD工具
 - 和贸泽一起探索人工智能-射频与无线技术

得捷电子 授权分销商

OPA397 单路低失调、低噪声 RRIO e-trim™ 运算放大器

满 300 元人民币免运费

[了解详情](#)

EV集团企业技术总监托马斯·格林斯纳 (Thomas Glinsner) 表示: “EV集团深耕纳米压印技术领域二十余载, 我们将继续在这一重要领域开拓创新, 开发出新型解决方案, 满足不断变化的客户需求。EVG7300是EV集团纳米压印解决方案系列的最新成员, 将我们的SmartNIL全场压印技术与透镜成型和透镜堆叠技术结合于顶级系统, 拥有市场上最精确的调准和工艺参数控制功能, 为我们的客户带来了前所未有的灵活性, 足以满足行业研究和生产需求。”

EVG7300系统既可作为独立工具, 也可用作EV集团HERCULES® NIL全面集成型UV-NIL跟踪解决方案中的集成模块。UV-NIL解决方案可添加额外的预处理步骤, 例如清洁流程、抗蚀剂涂层、烘焙或后处理等, 以满足特定工艺的优化需求。EVG7300系统结合了调准平台改进、高精度光学、多点间隙控制、非接触式间隙测量和多点力控制等技术, 达到了业内领先的调准精度 (最低可至300纳米)。EVG7300是一种高度灵活的平台, 提供三种工艺模式 (透镜成型、透镜堆叠和SmartNIL纳米压印), 支持从150毫米到300毫米晶圆的基板尺寸。该高效平台能够快速加载印靶和晶圆、快速调准光学器件、提供高功率固化功能, 且工具尺寸小巧, 能够充分满足行业对新型晶圆级光学系统 (WLO) 产品的制造需求。

SmartNIL®配备了增强现实波导和晶圆级显微镜镜头压印功能, 使新的EVG®7300系统拥有广泛的应用场景

产品上市信息

EV集团现已开始接受该系统的订单, 同时, 可在EV集团总部的NILPhotonics®技术中心观看产品演示。

关于 EV 集团(EVG)

EV集团 (EVG) 是为半导体、机电系统 (MEMS)、化合物半导体、功率器件和纳米技术器件制造提供设备与工艺解决方案的领先供应商。主要产品包括: 晶圆键合、薄晶圆处理、光刻/光刻纳米压印 (NIL) 与计量设备, 以及光刻胶涂布机、清洗机 and 检测系统。EV集团成立于1980年, 可为全球各地的客户和合作伙伴网络提供服务与支持。

欢迎分享本文, 转载请保留出处: <https://www.eechina.com/thread-782940-1-1.html> 【打印本页】

网友评论

富文本编辑器高级模式

您需要登录后才可以发表评论 [登录](#) | [立即注册](#)

[发表评论](#)

<https://www.eechina.com/thread-782940-1-1.html>